

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成20年6月26日(2008.6.26)

【公開番号】特開2007-80594(P2007-80594A)

【公開日】平成19年3月29日(2007.3.29)

【年通号数】公開・登録公報2007-012

【出願番号】特願2005-264573(P2005-264573)

【国際特許分類】

H 01 H 33/66 (2006.01)

【F I】

H 01 H 33/66 K

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月14日(2008.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

浮遊電位の金属容器と、該金属容器内に固定され、かつ並べて配置される二つの絶縁ブッシングからなる真空容器と、該真空容器内に備えられる二対の接離可能な電極対と、前記金属容器と対向して配置される真空圧力診断用の測定端子と、前記金属容器と前記測定端子をモールドする絶縁物と、該絶縁物の外周部に設けられる接地層とを備え、該接地層と前記測定端子は電気的に絶縁されてなる真空開閉装置。

【請求項2】

浮遊電位の金属容器と、該金属容器内に固定された絶縁ブッシングからなる真空容器と、該真空容器内に備えられる二対の接離可能な電極対と、前記真空容器とは別の真空容器と、該別の真空容器に少なくとも一対の接離可能な電極対を備える真空接地開閉装置と、前記金属容器と対向して配置される真空圧力診断用の測定端子と、該測定端子、前記金属容器及び前記真空設置開閉装置とを一体にモールドする絶縁物と、該絶縁物の外周部に設けられる接地層とを備え、該接地層と前記測定端子は電気的に絶縁されてなる真空開閉装置。

【請求項3】

浮遊電位の金属容器と、該金属容器に固定された絶縁ブッシングからなる真空容器と、該真空容器内に少なくとも一対の接離可能な電極対を備えた真空開閉装置において、前記金属容器を絶縁物でモールドすると共に、該絶縁物の外周部に一部の領域を除いて接地層を設け、前記絶縁物の外周部の一部の領域に対向して真空圧力診断用の測定端子が配置されていることを特徴とする真空開閉装置。

【請求項4】

請求項1から3のいずれかに記載の真空開閉装置において、前記測定端子に発生する系統波数の交流電圧を測定あるいは常時監視する診断装置を備え、該診断装置は、ある閾値以上の電圧上昇が発生した場合に真空不良と判定することを特徴とする真空開閉装置。

【請求項5】

請求項1から4のいずれかに記載の真空開閉装置において、前記絶縁物の外周に導電塗装が施され、該導電塗装を接地することで前記接地層を構成することを特徴とする真空開閉装置。

【請求項6】

請求項 4 に記載の真空開閉装置において、前記診断装置は、前記真空開閉装置に動作指令が与えられていない時に、前記測定端子に発生する電圧を測定し、ある閾値以上の電圧上昇が発生した場合に真空不良と判断することを特徴とする真空開閉装置。